

来源: [科学网 www.sciencenet.cn](http://www.sciencenet.cn) 发布时间: 2008-5-7 18:2:6

小字号

中字号

大字号

科技部 863新材料“大尺寸超高纯铝靶材”项目申请

据科技部网站消息:物理气相沉积(PVD)是半导体芯片和TFT-LCD生产过程中最关键的工艺之一,PVD用溅射金属靶材是半导体芯片生产及TFT-LCD制备加工过程中最重要的原材料之一,溅射金属靶材中用量最大的是超高纯铝和超高纯净铝合金靶材。研发具有自主知识产权的大尺寸超高纯铝靶材的制造关键技术,开发出满足半导体行业及TFT-LCD产业需求的超高纯铝靶材产品,对于我国相关产业的发展具有重要意义。

为公正、公平、公开地选择项目承担单位,充分调动相关企业、科研院所及高等院校的积极性,集成全国在铝的精炼提纯、大尺寸铝板形变加工及溅射金属靶材专业制备等领域的优势研发力量开展本项目的工作,科技部特此发布《国家高技术研究发展计划(863计划)新材料技术领域“大尺寸超高纯铝靶材的制造技术”重点项目申请指南》。

详情请见: [国家高技术研究发展计划\(863计划\)新材料技术领域“大尺寸超高纯铝靶材的制造技术”重点项目申请指南](#)

发E-mail给:



打印 | 评论 | 论坛 | 博客

相关新闻

- 科技部发布十一五国家科技支撑计划两重点项目申请...
- 科技部 国家科技支撑计划两重点项目课题申请指南...
- 科技部发布十一五国家科技支撑计划两重点项目申请...
- 科技部发布“十一五”国家科技支撑计划十重点项目...
- 科技部发布863先进制造技术领域四重点项目申请...
- “十一五”国家科技支撑计划两重点项目申请指南发布
- 卫生部发布“十一五”科技支撑计划四项目课题申请...
- 国家科技支撑计划“缺氧区业务化监测关键技术”申...

一周新闻排行

- 美宇航员将登陆可能撞地球的小行星 直径仅40米
- 08年国家自然科学基金申请项目初审结果公布
- 教育部公布08年具有招生资格的普通高校名单
- 中国卓越研究奖5月28日将在北京颁发 24篇论...
- 杨振宁谈与丘成桐的分歧
- 俄科学家预言未来10年将发生毁灭性大地震
- 教育部公示2008年推荐享受政府特殊津贴人选
- 198所普通高校本科教学工作水平评估结果公布